解説

希ガス固体表面における電子遷移誘起脱離

桜井 誠, 平山 孝人*, 荒川

> 核融合科学研究所 *学習院大学 理学部

Desorption Induced by Electronic Transitions on the Surface of Solid Rare Gases

Makoto Sakurai, Takato Hirayama' and Ichiro Arakawa'

National Institute for Fusion Science *Department of Physics, Gakushuin University

Electron- and photon-stimulated desorption process has been extensively investigated with the recent improvement of the experimental techniques. The application of synchrotron radiation as the means of primary excitation, which enables well-defined initial excitations, is a key to obtain detailed information on the desorption processes. Desorption induced by electronic transitions (DIET) on the surface of solid rare gases is of substantial interest in view of the characteristic feature that excitonic process has much importance in the DIET of rare gases, which is the extreme case of DIET where a comparatively thick bulk layer gathers up primary excitation and channels it selectively to the surface, leading to desorption. In this article, our experimental results on electron- and photon-stimulated desorption from solid rare gases in both excitonic excitation and inner-shell ionization regions are presented including the outlook over the field of DIET.

1. はじめに

固体の表面層に光子や電子を照射したときに, 電子励起を媒介として、その緩和過程の結果とし ライド、希ガス固体など、多岐にわたる。このよ て、表面からイオンや中性の粒子が放出される現

象がある。これまで研究の対象とされてきた系 は、金属や半導体表面上の吸着ガス、アルカリハ うな電子的遷移による脱離過程に関連した現象に

-13-

ついての物理と応用を対象とした国際ワークショ ップが、"Desorption Induced by Electronic Transitions: DIET"と題して、1982年以来、ほぼ2.5年 に一度の割合で開かれており、回を重ねるごと に、新しいDIETのモデルや理論が提唱され、測 定対象や実験手法が新しい展開を見せるととも に、半導体プロセスなどへの応用研究も定着して きた¹⁻⁴⁾。DIETは固体表面上の動的過程に関連し た研究対象の一例として、比較的単純で研究の歴 史も古い重要な分野であるが、残念ながら、我が 国では表面科学上の研究対象としての認識はあま り広いとはいえない。

DIET についての認識がされ始めたのは,電離 真空計の動作時の脱ガス現象が電子衝撃脱離 (Electron Stimulated Desorption: ESD)の効果とし て理解された,超高真空技術の揺藍期(1960年前 後)に遡る。実験技術的には,ESDイオンの収率 測定に始まり,中性粒子の測定,イオン脱離の角 度分布の測定,励起中性粒子の測定,負イオンの 測定へと広がってきた。また放射光の物性研究へ の利用が進むにつれ,光子による励起を用いた光 脱離(Photon Stimulated Desorption: PSD)の実験が 一般化し,選択的な励起が可能であることから, 電子線による励起よりも精密な解析ができるよう になり,DIET 機構の研究に放射光は欠くことが

ESDと PSDの脱離断面積を比較すると、金属表面上に化学吸着した分子の場合の典型的な値は、 ESDイオンが 10⁻¹⁸ cm²、PSDイオンが 10⁻²⁰ cm²であり、ESDの方が遙かに大きい。また、既に述べた真空技術上の問題として捉えられたことにも代表されるように、応用面では ESDの方が直接的な重要性をもつと言える。しかし、DIETの素過程の研究という点では、上に述べた意味で PSD がより有用な手法であるといえる。

出来ないものとなっている。

実用表面における荷電粒子や光子による DIET 過程という意味では、プラズマ・核融合研究にお ける炉工学上の、また、加速器・放射光科学にお ける真空技術上の問題との関連も大きい。前者で は真空容器内壁の清浄化処理(コンディショニン グ)や放電時のリサイクリング過程において,電 子・イオンと表面との相互作用が主体となるが, 後者では高エネルギー光子と表面との相互作用が 主要な一次過程である。さらに,最近では DIET をもっと積極的に工業的応用に利用することを目 的とした研究が増えている。

我々は最近,低温のCuなどの固体表面上に希ガ スを凝縮させ,光子や電子衝撃による希ガスの励 起中性粒子やイオンの脱離を観測し,その運動エ ネルギー分布や脱離収率の入射エネルギー依存 性,入射角依存性を測定することにより,希ガス 固体からのDIET について幾つかの知見を得るこ とができた。ここでは,希ガス固体などの気体凝 縮相におけるDIET の研究の動向と,我々の実験 結果について述べる。

2. DIET 機構の概説

ESDを理論的に説明する最初のモデルは, Menzel と Gomer⁵⁰ および Redhead⁶⁰ により, 1964年に 提唱された MGR機構と呼ばれるものである。この モデルは,金属表面上に化学吸着した分子のよう な共有結合をした系の脱離現象をうまく説明する ことができた。1980年前後から,イオン結合や物 理吸着をした系での DIET に対して新しいモデル が唱えられ,最近になってようやく様々な系の DIET 過程についてそれぞれ適応できるモデルが出 そろってきたと言える。以下に,これまでに提唱 された DIET の機構について簡単に述べる。詳細 は他の文献^{1-4,7-90} を参照されたい。

A. MGR 機構

気相における分子の解離機構を応用したもので あり,電子励起により基底結合状態から反結合状 態へのフランク-コンドン遷移を誘起し,脱離が 起こるとするものである(図1a)。これにより, 脱離のしきい値エネルギーや脱離粒子の運動エネ



Fig.1 Potential energy diagrams for the processes of DIET: a) MGR model, b) Antoniewicz model.

ルギー分布が議論され,多くの実験結果はこのモ デルの妥当性を示している。一般に,金属表面上 の吸着分子のESDの全脱離断面積は10⁻¹⁸ cm²程度 以下で,気相の電子励起断面積に比べると非常に 小さく,またイオンの脱離は中性粒子に比べ圧倒 的に少ないが,これらのことは脱励起による再捕 獲過程や,オージェ中性化過程の確率から定性的 に説明することができ,また,タングステン表面 上の吸着水素のESDに見られる著しい同位体効果 もMGR 機構で説明できる。

B. Antoniewicz 機構

Antoniewicz¹⁰は、MGR 機構では脱励起による 再捕獲の確率が過大評価されてしまい、実際の脱 離収率を再現し得ないことを指摘し、イオン化結 合状態への遷移を介して脱離が起こるとする新し いモデルを提唱した(図 1b)。中性粒子の脱離の しきい値エネルギーの観測結果¹¹⁾が、イオン化結 合状態への遷移を示唆していることや、負イオン の運動エネルギーが正イオンのそれより大きいこ とを示した O_2/W に対する実験結果¹²⁾が Antoniewicz機構を支持する根拠となっていた。当 初はその妥当性を疑問視する向きもあったが、最 近では金属表面上の物理吸着層の DIET 機構の一 つとして認められている¹³⁾。

C. Knotek-Feibelman 機構

Knotekと Feibelmanは, 1978年に TiO₂からの O⁺ イオンの ESD を観測した¹⁴⁾。イオン結晶である TiO₂中の酸素は O²⁻として存在するため, この実 験結果は従来の MGR機構などの一電子過程では説 明できない。彼らは O⁺ 脱離しきい値エネルギー が, Tiの 3p電子の結合エネルギーに対応している ことなどから,内殻電離とそれに続くオージェ過 程を考え,終状態における陽イオン同士の反発力 で脱離が起こるとする,Knotek-Feibelman(KF)機 構を唱えた。このモデルは,アルカリハライドな どのイオン結晶における,内殻励起エネルギー領 域の DIET 機構として,広く認められている。

D. Pooley-Hersh 機構

アルカリハライドにおけるハロゲン原子のDIET の機構としては Pooley¹⁵と Hersh¹⁶により提唱さ れた過程が良く知られており,これは1)ハロゲン イオンの励起,2)隣接するハロゲンイオンとの結 合によるH⁻-中心の生成,3)H⁻-中心の,F-中心 とハロゲンイオン・ハロゲン原子への解離,の三 段階で脱離が起こるとするものである。アルカリ 金属の脱離については表面上に残されたアルカリ 金属の蒸発によるものとされている。

E. 多重正孔局在によるイオン脱離機構

CO/W(100)のような共有結合の系において, 内殻励起によるイオン脱離が観測された¹⁷⁾。この 系では正孔の局在による反発力を脱離の起源とす るKF機構が適用できない。内殻励起の後に引き起 こされるオージェ過程で生成される多重正孔 が、もし脱離を起こすのに要する時間の程度(10⁻¹³ 秒)局在していれば、気相分子の解離過程のモデ ルであるクーロン爆発と同様に、多重正孔による 反発力から脱離が引き起こされる。実際、正孔の 移動度は正孔間の相互作用の影響を受け、価電子 帯のエネルギー幅に対して正孔間相互作用エネル ギーが大きい場合、脱離の収率は観測できる程度 に大きくなる¹⁸⁾。

実際観測される脱離粒子のエネルギー分布や方 向分布を説明するためには,上記の脱離機構のモ デルだけでなく,該当する遷移に対応したポテン シャルエネルギー曲面についての情報が必要であ る。これについては,クラスター計算や密度汎関 数を用いた計算がなされている。また,脱離収率 は励起状態の寿命に左右されるので,系の過渡的 応答についての解析が必要になる。この興味深い



Fig.2 Resonance enhanced desorptive probability vs resonance lifetime for atomic oxygen on Pd(111) treating adsorption equilibrium location with respect to the image plane parametrically. (from ref. 19)

例として、O/Pd(111)における脱離収率の増大を 形状共鳴で説明するGadzuk¹⁹⁾の報告がある。図2 はO/Pd(111)の系において、脱離の確率と共鳴の 寿命の関係を表したもので、特定の寿命のところ で脱離の確率が極大値をとることを示している。

3. 希ガス固体の DIET-研究経過

ここでは希ガス固体を対象とした PSDや ESDの 研究について概観しよう。希ガス固体の DIET で は,表面に局在した励起状態が直接脱離に結びつ く過程と、固体内部に生成された励起状態が、表 面への拡散と励起緩和を経て脱離に至る二つの過 程が知られている。また、励起源のエネルギーが 内殻準位の領域の場合と,励起子生成の領域の場 合とで、それぞれに特徴的な脱離現象が観測され る。希ガス固体の DIET に関連した研究は、初め 原子力工学などの応用上の要請から、高エネル ギーの電子線(~keV)などの照射による、スパッ タリングや昇華(Erosion)について研究されること が多かったが²⁰⁻²³⁾、この場合も脱離に直接関わる のは、希ガス固体中の電子線の飛跡の周りに生成 される励起子のエネルギー緩和過程であることが 示されている。最近では、より問題の本質を追求 するにふさわしく, 電子励起過程を直接誘起し得 る, ESDやPSDに関する報告が多くなってきてい 3 24 - 26) 0

図3²⁵はRu(001)面上のAr薄膜(単原子層〜数 原子層)におけるAr分子のPSD収率の,固体Ar の励起子生成領域でのエネルギー依存性を示して いる。光学的吸収スペクトルでこれまで同定され ていた励起子によるピークに対応して,脱離原子 の収率が極大を示している。これは励起子の種々 の緩和過程の結果として脱離が起こる(後述の Excimer-Dissociation モデルや Cavity-Ejection モデ ル)ことを明瞭に示している。ただし,この例で は四極子型質量分析計で測定しているため,基底 状態と励起状態のAr原子がともに検出されてお り,この段階では脱離機構の詳細を明かにするに



Fig.3 Photon-stimulated desorption from Ar (curve a) monolayer and (curves b-d) multilayers (1.5, 2.5, and 6.0 nm in thickness, respectively) compared with (curve e) absorption of a 2.3 nm layer. Arrows indicate the energy positions of bulk and surface excitions (from ref. 25).

は至っていない(単原子層の場合, Antoniewiczの モデルに類似の脱離機構により基底状態のAr原子 が脱離していると論じられている)。

Ar固体において, さらに光子のエネルギーが高 いときの, イオンの脱離についての測定例を図4²⁶ に示す。ここではArイオンの種々のサテライト状 態に対応した位置に, 脱離収率の増加が観測され ている。

4. 実験方法

PSD及び ESD の実験は、それぞれ分子科学研究 所 UVSOR (極端紫外光実験施設)と学習院大学 理学部で行った。以下にそれぞれの実験装置及び 実験方法について概略を説明する。

4.1 PSD 実験

UVSOR - BL5Bの測定装置の概観を図5に示 す^{27,28)}。放射光は,平面回折格子分光器(PGM)で



Fig.4 Ar⁺ ion yield from solid argon. The arrows indicate the threshold energies of the various satellite states (from ref. 26).

単色化される。波長領域は 2.0-240nm で, スリッ ト幅 30 μ mにおける設計分解能 ($\lambda/\Delta\lambda$) はこの 波長領域で 500 ± 200 である。つまり希ガスの内 殻励起領域から励起子の励起エネルギー領域を見 ることができる。飛行時間(time-of-flight, TOF) 測定により、脱離した準安定状態の中性粒子のエ ネルギー分布を測定するため、励起光は第一試料 槽に設けてあるチョッパーでパルス化されて PSD 実験用の超高真空槽に導入される。チョッパー は, 直径 39cm のジュラルミンの円盤に幅 1mm の スリットを10個ほぼ等間隔に入れたもので、これ を毎秒約50回転させることにより、幅16µs、間 隔2msのパルス列を得ている。PSD用真空槽には 試料冷却用の液体ヘリウムクライオスタット(あ るいは閉サイクル冷凍機を用いたクライオヘッ ド)と2個の検出器(チャンネルトロン,および セラトロン)が組み込んである(図6)。クライオ スタットは最大径 90mm,長さ 600mmで,ヘリウ ム溜めの容量は0.5 ltrとなっている。表面は電解 複合研磨が施されている。クライオスタットの底 には銅の単結晶(Cu(100))が絶縁用のサファイア 単結晶を介して取り付けられている。クライオス タットの底と銅単結晶には金鉄クロメル熱電対が





Fig.5 Schematic view of the plane grating monochromator (PGM) and the vacuum chambers at BL5B of UVSOR. The first premirror is not shown here.



Fig.6 Experimental setup around the substrate. The 'L' shaped Cu block is attached to the bottom of a cryostat.

取り付けられている。また、銅単結晶基盤の前に は、脱離イオン測定の際の静電シールドのための メッシュが設けられている。クライオスタットは 上下移動と回転が可能なステージに取り付けられ ている。回転機構には2段の差動排気型回転フラ ンジ(Thermionics, RNN400)を使用しており、真 空槽の到達圧力(4×10⁻⁸ Pa以下)を乱すことな く、クライオスタットを回転させ、試料表面への 励起光の入射角を変えることができる。検出器は 真空槽内に設けられた回転ステージに取り付けら れており、これも試料の周りを光の反射面内で回 転させることができる。

希ガス固体薄膜は,バリアブルリークバルブか らガスを真空容器全体に満たし,基盤表面に凝縮 させて作成する。膜厚は熱シールド内の圧力と露 出時間から凝縮係数を1として計算した。ただ し,熱シールド内の圧力は容器内のガス圧力を熱 シールドのスリットのコンダクタンスで補正した 値を用いた。典型的なガス導入中の容器内の圧力



Fig.7 Schematic diagram of the TOF measurement system: (a) electronic block diagram and (b) time chart for gating. The gate of counter is controlled so that photon signals are excluded from the metastable signals.

は10⁻⁴ Pa台である。

励起中性粒子の TOF測定では図 7aに示した回路 系を用いた。脱離粒子の TOFスペクトルはマルチ チャンネルアナライザ (MCA7800,セイコー EG & G)のマルチチャンネルスケーラ (MCS)モー ドで測定しており、チョッパーのスリット位置を 発光ダイオードとフォトダイオードで構成した検 出器で検知し、適当な遅延回路を経て MCSのトリ ガーとした。この TOFスペクトルには散乱された 励起光のピークや脱離機構の違いに対応して異な る位置に励起中性粒子のピークが現れる。特定の ピークの強度の入射波長依存性を測定するため、 分光器の波長をステップ的に変えながら、TOF信 号にゲートをかけて測定した(図 7b)。

イオンの PSDでは、複数イオン種が脱離してい ることが予想されたため、試料にパルス的なバイ アスを印加し、100eV 程度に加速して、脱離イオ ンの質量スペクトルを TOFで測定した(図8)。こ の測定では、時間波高変換器とマルチチャンネル アナライザの波高分析(PHA)モードを用いてい る。

4.2 ESD 実験

ESD実験では二つの測定系を用いた。

Ne, Ar 固体における励起中性粒子脱離の実験 は、上述の液体ヘリウムクライオスタットを到達 圧力 10⁻⁹ Paの極高真空槽に取り付けて行った。励 起源が電子ビームであること以外は、前項で紹介 した PSD 実験の場合とほぼ同様の方法で行われ る。電子銃、励起中性粒子検出器(チャンネルト ロン又はセラトロン)が設置されている²⁹⁾。電子 銃はサンプル垂直方向から50°方向に固定され、 検出器はサンプル表面を中心として-15°から60° の範囲で回転できる。電子銃は、市販のCRT用 の電子銃に上下左右方向の偏向板を取り付けたも ので,エネルギー範囲10~500eVで,ビーム径約 1mm, 電子電流 0.1 ~ 10 µA 程度の安定したビー ムを得ている。電子銃の第一グリッドにパルス電 圧を印加することにより電子ビームはパルス化 (パルス幅約1~10 μ sec)され, PSD実験と同様 の方法で、励起中性粒子の TOF スペクトルが測定 される。

脱離イオン測定に用いた装置図を図9に示す³⁰⁾。 装置全体は到達圧力10⁻⁸ Paの超高真空槽に収めら れている。機械式冷凍機により30K以下に冷やさ



Fig.8 Block diagram of electronic circuit for TOF measurement of desorbed ions by pulsewise extraction.



Fig.9 Schematic diagram of the apparatus used for the measurement of desorbed ions in ESD experiment.

れた多結晶 Cuを基盤として用い、その表面に希ガ ス原子を数100層凝縮させ希ガス固体を生成す る。電子銃は基盤に対して45°方向に設置され、 加速エネルギー100eVで10 µA程度の電子電流が 得られるが,希ガス固体のチャージアップの影響 を最小限に押えるために、測定は1μA程度の電流 で行った。また、接触電位差や標的のチャージア ップの補正を行っていないので、入射電子エネル ギーには±数eV程度の誤差があると思われる。希 ガス固体表面から脱離したイオンは、Cu基盤に印 加されたバイアス電圧(10~30V)によって加速 され、静電レンズ系により収束される。四極子型 質量分析計(QMS)により質量弁別された脱離イ オンは、二次電子増倍管でパルス検出され、適当 な検出回路を通した後、マイクロコンピューター に取り込まれる。QMSと電子加速電源をマイクロ コンピューターでコントロールすることにより, 質量スペクトル及び脱離イオン収率の入射電子エ ネルギー依存性を測定することができる。



Fig.10 Ar' PSD TOF spectra at a photon energy of (a) 13.8 eV and (b) 12.2 eV. The center of the photon peak is chosen as the origin for the flight time measurement. The number of accumulations is 2×10^5 and 2×10^4 for (a) and (b), respectively.

5. 実験結果と考察

5.1 希ガス固体からの励起原子の DIET

図10³¹⁾はAr固体から光脱離したAr励起原子の TOFスペクトルである。試料の膜厚は図10aが 1100原子層,図10bが500原子層である。図10a では入射光のエネルギーは13.8eVで,図10bは入 射光のエネルギーが12.2eVの場合であり、それぞ れバルクの2次の励起子と表面励起子の生成エネ ルギーに相当する。図10aでは励起原子のピーク が2箇所に現れているが、そのエネルギーはそれ ぞれ0.6eVと0.04eVである。図11³²⁾は入射電子の エネルギー 200eVにおけるAr固体からのESDの



Fig.11 Typical TOF spectrum of ESD species from the surface of solid Ar.

TOFスペクトルである。膜厚は 1000原子層で,基 盤の温度は 25K である。励起中性粒子の脱離ピー ク(B, C)の位置は PSDの場合(図 10a)とほぼ 同様の値を示している。脱離粒子の運動エネル ギーが2種類の値を持つということは,励起中性 粒子の脱離の過程が2つあることを意味してい る。また生成される励起子の種類によって,脱離 の過程が異なることも分かる。このことは Ne 固体 でも測定されている³³³⁴(図 12³⁴)。図 13は図 7bに 示した方法で,励起中性粒子の信号強度の入射光 波長依存性を測定した結果である。Ar 固体の光学 的吸収スペクトルの構造に相似の,励起子スペク トルが明瞭に現れている。図 10,11 に見られる 2 つのピークの起源は,以下のように説明されてい る。

光励起により希ガス固体中に生成された自由励 起子は、緩和過程を経て準安定状態である自己束 縛励起子(Self-trapped exciton, STE)になるが、 このSTEには希ガス原子1個に局在した原子状の もの(atomic-STE, a-STE)と2つの原子に跨った ダイマー状のもの(molecular-STE, m-STE)が ある。NeとArの固体におけるa-STEは周囲の希 ガス原子から斥力を受け、そのまま準安定原子と して脱離する。脱離の際に獲得する運動エネル ギーの最大値は、励起子の生成エネルギーから希



Fig.12 TOF spectra of metastable atoms desorbed from solid Ne under primary excitation of surface exciton (curve (2), $h\nu$ =17.17 eV) and of surface type $2p^{5}3p$ excitations (curve (1), $h\nu$ =19 eV)(from ref. 34).

ガス原子の遷移エネルギーと凝縮エネルギーを引 いたものと考えられ、Ne 固体の場合 0.5eV, Ar 固体の場合0.1eV程度となる。実際には脱離の際 希ガス固体に上記のエネルギーの一部が格子振動 のエネルギーとして分け与えられるため、さらに 小さな値となる。分子動力学的シミュレーション によれば、上記の40%~70%が脱離粒子に与え られるとされている³⁵⁾。図10などに見られる遅い 方のピークはこの値によく合っている。この脱離 機構は Cavity-Ejection (CE)機構と呼ばれている。 KrやXeは固体における電子親和力が正であるた め、励起子には引力が働く。このため、KrとXe の固体では遅い励起原子の脱離は観測されない。 一方、速いピークの方は高励起状態、あるいはイ オン化されたダイマーの解離性の脱励起で放出さ れる励起原子であると解釈され、この過程は図14 のポテンシャル曲線で説明される。この脱離機構 は Excimer-Dissociation (ED) 機構と呼ばれる。従 って、入射光のエネルギーが高励起状態の励起子 を生成するのに十分でない場合は、速いピークは 現れない。

希ガス(我々の実験では Ne)の凝縮層の膜厚を 数原子層から増して行ったときの,励起原子の脱



Fig.13 Dependence of the Ar signal intensity on the wavelength of light from 80 nm to 110 nm. The line is drawn as a visual aid.



Fig.14 Petential energy diagram of solid Ar (from C. T. Reimann et al., in ref 4, p.226).

離収率の変化を観察すると、バルクの励起子を励 起する場合は膜厚を増すに従って、収率が増加す るのに対し、表面励起子を励起した場合は、膜厚 が数原子層の段階で顕著な脱離が観測され、収率 が膜厚に依存しないことが示された。これは、3 節の冒頭で述べたように、表面に局在した励起状 態を誘起することにより直接脱離に結びつく過程 と、固体内部に励起状態を生成し、表面への拡散 と励起緩和を経て脱離に至る過程の双方が起きて いることを意味する。これを膜式的に描くと、図 15のようになる。



Fig.15 Illustration for excitonic DIET processes in solid rare gases.

次に、Ne 固体からの ESD の角度分布について 述べる。図15から容易に想像されるように、CE 機構と ED 機構では、脱離の方向分布が異なるこ とが予想される。図16²⁰⁾は入射電子エネルギー 100eV において、TOF スペクトルに見られる2つ の励起原子の脱離ピークの、それぞれの収率の角 度分布を測定した結果である。遅いピークは、表 面に垂直方向に鋭く集中しており、CE機構に由来 する脱離現象であることと対応している。これに 対し速いピークの場合は、角度分布が広いうえ に、表面の垂線から大角度で放出される粒子が多 く、ED 機構による脱離過程を裏付けている。

5.2 希ガス複合層での励起原子の脱離

ここでは Neの単原子層を別の種類の希ガス固体 上に生成した場合について、Neの表面励起子の生 成による脱離現象を Ne固体の場合と比較する。図 17³⁶⁾は Xe 固体上の Ne 薄膜と、Ne 固体について の、PSDの収率の入射エネルギー依存性を示す。 Neの膜厚が増えるに従ってバルクモードの励起に よる脱離収率が増すことに加えて、表面励起子 (S1 および S')による脱離収率のピーク位置がシ フトしていることがわかる。とくに S1の場合が顕 著で、Ne/Xe(θ = 1.4) と Ne単体の差は 0.17eV







Fig.17 Desorption yields of Ne* as a function of a photon energy. θ is a thickness of a Ne film on solid Xe.

である。これと対応してTOFスペクトルに見られ る脱離ピークの位置も図18のように変化する。同 様の測定をAr固体とKr固体上のNe薄膜について



Fig.18 TOF spectra of Ne desorbed from Ne film on solid Xe by S1 excitation.

も行い, Neの膜厚と脱離した Ne 励起原子の運動 エネルギーとの関係について整理したところ、図 19のような結果を得た。即ち、Xe、Krなどの異 種の希ガス固体上の Ne層は膜厚が薄いときはそれ ぞれの系固有の値を示すが、膜厚が厚くなるにつ れて、バルクの Neの値に連続的に近づいている。 これは、 Ne/ RGS 複合層においても Ne 励起原子 はCE機構で脱離することを示唆する。また、S1 励起子の励起エネルギーのシフト量と脱離励起原 子の運動エネルギーのシフト量の比はほぼ一定の 値を示す。このことは、脱離原子に与えられる運 動エネルギーの起源が、励起子の生成エネルギー と気相の遷移エネルギーなどとの差である格子歪 みエネルギーの一部からくるという CE機構の解釈 とも整合している。ところで、 Ne 固体では TOF スペクトルの遅いピークは CE機構に由来するが, KrやXeの固体では、固体における電子親和力が 正であるため、CE機構による脱離は有効に働かな い。KrやXeの固体上のNeの脱離をCE機構で説 明するためには、Neのa-STEへの斥力を与える効 果が必要となるが、これを明かにするためには、 励起子の緩和過程における異種の希ガス原子間の 相互作用を知ることが重要になる。



Fig.19 Kinetic energies of Ne^{*} desorbed by S1 excitation from Ne adsorbed on Ar, Kr, and Xe solids.



Fig.20 TOF spectra of desorbed ions from solid rare gases: (a) Kr and (b) Xe. The incident photon energies are 155 eV for (a) 100 eV for (b). Mass to charge ratios of identified peaks A, B and C are 18 or 19, 28, and 40, respectively. The peaks 'D' correspond to Kr⁺ and Xe⁺ for (a) and (b), respectively.

5.3 希ガス固体からのイオンの DIET

ここでは,主に内殻電離を一次過程として起こ る,希ガスイオンや他の不純物イオンの脱離につ いて得られた結果を述べる。

Kr,および Xeの固体では、入射光子のエネル ギーを100~200eV程度にして5.1と同様の測定 を行ったところ, TOF スペクトルにエネルギー 5eV程度のピークが観測された。5.1の場合と異 なり、検出器のメッシュに阻止電位をかけると ピークが消えることと、 ピークの幅の変化から、 幾つかのイオン種が脱離していることがわかっ た。光をチョップする方式の TOF 測定では質量分 析の十分な分解能が得られないので、図8に示す ようにパルスバイアスを印加する TOF 測定の方法 で, 質量スペクトルを測定した。図 20³⁷⁾は Kr,お よび Xe 固体における PSD イオンの TOF スペクト ルである。図中に示した質量数からわかるよう に、KrやXe以外のイオンが主体であることがわ かる。 $m/e = 19(H_3O^+), 28(N_2^+, CO^+)$ などは真 空容器中の残留ガスに由来し、希ガス固体の表面 に吸着したものが光励起により脱離したものと考 えられるが、組成比としては僅かであるこれらの 不純物が脱離イオンの主体となっていることは驚



Fig.21 Wavelength dependence of the ions desorbed from the surface of solid Kr at the core excitation region.

きである。これらの脱離イオンの収率は入射光子 のエネルギーに依存し,吸着下地となっているそ れぞれの希ガスの内殻電離エネルギー周辺で極大 を示した。KrやXeの吸収スペクトルは,それぞ れ3d及び4d殻の電離エネルギーを少し越えたと ころに幅の広い極大を示し,巨大共鳴と呼ばれる 構造を持つが,PSDによるイオンの脱離収率はこ れと良く対応している。図21はKr固体からの PSDイオンの収率を,入射光子のエネルギーを変 えて測定した結果である。図7bに示したように



Fig.22 TOF spectrum obtained from a Xe film in the presence of a small amount of Kr at the substrate temperature of 30 K.

ゲートをかけて脱離イオンだけを計数している。 図中の破線は阻止電位をかけた場合である。この ように不純物イオンの脱離収率が希ガス固体の吸 収スペクトルと対応することは、希ガス固体中あ るいは表面の不純物分子が光子により直接励起さ れるのではなく、脱離の一次過程として希ガスが 励起され、この緩和過程において不純物分子の脱 離が選択的に起こることを示唆している。図22は Xeの固体にKrを僅かに混ぜた場合のPSDイオン を測定したもので、この場合もXeの母相に僅かに 存在するKrの信号が主体となっている。

図 23 に Kr 固体を標的としたときの ESD イオン の質量スペクトルを示す³⁸⁾。このときの入射電子 エネルギーは 600eV, Kr 固体の膜厚は約 120 層で ある。A-D のピークは,それぞれ Kr⁺, Kr²⁺, Kr³⁺, Kr₂⁺ に対応している。質量数の小さいとこ ろには,残留ガスによる不純物ピーク(H⁺, H₂O⁺ or H₃O⁺)が現れている。

ESDの場合, PSDのように希ガス固体中の特定 の励起状態のみを選択的に励起することはできな いが,脱離収率の入射電子エネルギー依存性を測 定することにより,脱離に関与する励起状態を推 定することができる。図24(実線)にKr固体か らのKr²⁺脱離収率の入射電子エネルギー依存性を 示す³⁰⁾。ESD Kr²⁺は, 80eV付近に脱離しきい値



Fig.23 A mass spectrum of ESD ions from solid Kr at an electron impact energy of 600 eV and a film thikness of 120 atomic layers. Peaks A-D are Kr^{*}, Kr²⁺, Kr³⁺, and Kr₂⁺, respectively.



Fig.24 Dependence of the ESD Kr²⁺ yield from solid Kr on the electron impact energy (solid line). Double (crosses) and triple (open circles) ionization cross sections of Kr by electron impact in the gas phase are also shown for comparison. Note that the vertical axis is arbitrary in 3 curves.

を持ち,110eV付近から収率の急激な増大が見られる。希ガス固体の結合力は,非常に弱いファン デァワールス力なので,固体中の原子の電子励起 及び電離過程に対する周囲の影響は小さく,孤立 原子の場合と同様の過程が起こっていると考えら れる。そこで,Kr²⁺の脱離に関与する電子励起過 程を明かにするため,気相における電離及び励起 過程についてのデータと比較してみる。図24の× 印と〇印は,電子衝撃による気相Kr原子の二重お



Fig.25 Threshold region of Kr^{2+} desorption yield. Arrows A-D show the energy positions of $4p^{-3}$, $3d^{-1}$, $3d^{-1}4p^{-1}nl$, and $3d^{-1}4p^{-1}$, respectively. The inset shows the curve of the desorption yields around the threshold region in an expanded scale.

よび三重電離断面積³⁹⁾である。この図の縦軸は, それぞれ適当に規格化してある。しきいエネル ギー及び曲線の形状ともに、気相と固相の間で明 かに違うことがこの図からわかる。すなわち、希 ガス固体上に基底状態のKr²⁺を生成してもそのま ま脱離することはなく、また、基底状態のKr³⁺が 周囲の原子からの電子移行の結果Kr²⁺として脱離 する過程も主たる脱離過程ではない。図25は、入 射電子エネルギー 75~125eVの範囲を拡大したも のである³⁰⁾。矢印 A-D は,気相における K r 原 子の電離及び電子励起準位のエネルギーを示した もので、それぞれ、4p⁻³(直接三重電離)、3d⁻¹(内 設電離), $3d^{-1}4d^{-1}nl$ (shake-up), $3d^{-1}4p^{-1}$ (shake-off)のエネルギーレベルに対応してい る。shake過程とは、内殻電子が電離する際に、同 時に外殻電子が励起(shake-up)あるいは電離 (shake-off)する過程である。この過程は多電子過 程であるので断面積は小さいと予想されるが, Kr²⁺の脱離収率は shake 過程のしきいエネルギー (矢印C, D)から急激に増大し、この shake 過程 がKr²⁺の脱離に主たる寄与をしていることがわか る。このような多電子励起状態(satellite状態)が イオンの脱離に大きな寄与をすることは、Ar固体 における PSD の実験でも報告されている²⁶⁾。

固体表面からのイオンの脱離は、隣接した正イ オン同士のクーロン反発力により起こると考えら れている。 Kr²⁺が脱離するためには,上述の励起 状態が緩和して最終的に隣接した正イオン(Kr²⁺ とKr⁺, あるいはKr²⁺とKr²⁺)が生成される必要 がある。我々の実験結果は、今まで一般的に考え られていたような原子内 Auger 遷移による内殻励 起状態の緩和過程を考えただけでは説明できな い。そこで我々は、隣接した原子との間での原子 間Auger 遷移を考慮に入れた新しいモデルを提唱 した^{30,38)}。詳しいことは省略するが,例えば shake-off過程による脱離の場合,まず隣接 Kr 原子 内の電子が $Kr(3d^{-1}4p^{-1})$ の内殻正孔を埋め、隣 接原子内の電子が Auger電子として放出される (原 子間 Auger 遷移)。その結果 Kr⁺と Kr²⁺ が隣接して 生成され、クーロン反発力により Kr²⁺が脱離する というものである。希ガス固体からのイオンの脱 離に関する研究はまだ歴史が浅く、上述した我々 のモデルの検証も、今後のより詳しい実験の結果 を待たなければならない。

6. おわりに

希ガス固体を対象とした電子遷移誘起脱離 (DIET)について,脱離機構の概要と希ガス固体 からの DIET に関連した研究の概観について述 べ,当該分野における,放射光などを用いた我々 の実験について紹介した。本稿では,希ガスの固 体すなわち低温基盤上の凝縮層に話を絞ったが, 酸素や窒素などの分子の凝縮層を対象とした DIET に関しても多くの研究がなされている。

謝辞

ここで引用した PSDの実験結果は全て分子科学 研究所 UVSOR にて行った。 UVSOR スタッフの 方々には実験初期の頃から大変お世話を頂き,こ の場を借りてお礼を申し上げます。また,これら の研究は、学習院大学大学院生星野晶君とアルゼ ンチン・コルドバ国立大学の Daniel E. Weibel 博士 と共同で行った。

文献

- Desorption Induced by Electronic Transitions I(DIET I), eds. N. H. Tolk, M. M. Traum. J. C. Tully and T. E. Madey (Springer, Berlin, 1983).
- Desorption Induced by Electronic Transitions II(DIET II), eds. W. Brenig and D. Menzel (Springer, Berlin, 1985).
- Desorption Induced by Electronic Transitions III(DIET III), eds. R. H. Stulen and M. L. Knotek (Springer, Berlin, 1988).
- Desorption Induced by Electronic Transitions IV(DIET IV), eds. G. Betz and P. Varga (Springer, Berlin, 1990).
- 5) D. Menzel and R. Gomer: J. Chem. Phys., **41**, 3311 (1964).
- 6) P. A. Redhead: Can. J. Phys., 42, 886 (1964).
- T. E. Madey and J. T. Yates, Jr.: J. Vac. Sci. Technol. 8, 525(1971).
- 8) D. Menzel: J. Vac. Sci. Technol., 20, 538 (1982).
- 9) 安江常夫:博士論文(名古屋大学)
- 10) P. R. Antoniewicz: Phys. Rev., B21, 3811 (1980).
- M. L. Knotek, V. O. Jones and V. Rehn: Phys. Rev. Lett., 43, 300 (1979).
- 12) M. L. Yu: Phys. Rev., B19, 5995 (1979).
- P. Feulner, D. Menzel, H. J. Kreuzer and Z. W. Gortel: Phys. Rev. Lett., 53, 671 (1984).
- 14) M. L. Knotek and P. J. Feibelman: Phys. Rev. Lett., 40, 964 (1978).
- 15) D. Pooley: Proc. Phys. Soc., 87, 245 (1966); 87, 257 (1966).
- 16) H. N. Hersh: Phys. Rev., 148, 928(1966).
- R. Franchy and D. Menzel: Phys. Rev. Lett., 43, 865 (1979).
- 18) D. A. Ramaker: in ref 2, p.70.
- 19) J. W. Gadzuk: in ref 4, p.2.
- 20) J. Schou, P. Borgesen, O. Ellegaard and H. Sorensen:

Phys. Rev., B34, 93 (1986).

- O. Ellegaard, R. Pedrys, J. Schou, H. Sorensen and P. Borgesen: Appl. Phys., A46, 305(1988).
- 22) D. J. O'Shaughnessy, J. W. Boring, S. Cui and R. E. Johnson: Phys. Rev. Lett., 61, 1635 (1988).
- 23) C. T. Reimann, W. L. Brown and R. E. Johnson: Phys. Rev., **B37**, 1455(1988).
- 24) E. Steinacker and P. Feulner: Phys. Rev., B40, 11348 (1989).
- 25) P. Feulner, T. Muller, A. Puschmann and D. Menzel: Phys. Rev. Lett., **59**, 791(1987).
- 26) G. Dujardin, L. Hellner, M. J. Besnard-Ramage and R. Azria: Phys. Rev. Lett., 64, 1289(1990).
- M. Sakurai, S. Morita, J. Fujita, H. Yonezu, K. Fukui, K. Sakai, E, Nakamura, M. Watanabe, E. Ishiguro and K. Yamashita: Rev. Sci. Instrum., 60, 2089(1989).
- 28) M. Sakurai, Y. Shimazu and N. Asakura: Rev. Sci. Instrum., 63, 832(1992).
- 29) D. E. Weibel, T. Hirayama and I. Arakawa: Surf. Sci. to be published.
- A. Hoshino, T. Hirayama and I. Arakawa: submitted to Surf. Sci.
- 31) I. Arakawa and M. Sakurai: in ref 4, p.246.
- 32) I. Arakawa, M. Takahashi and K. Takeuchi: J. Vac. Sci. Technol., A7, 2090 (1989).
- 33) T. Kloiber, W. Laasch, G. Zimmerer, F. Coletti and J. M. Debever: Europhys. Lett., 7, 77 (1988).
- 34) T. Kloiber and G. Zimmerer: Radiat. Eff. Def. Sol., 109, 219 (1989).
- 35) S. T. Cui, R. E. Johnson and P. T. Cummings: Phys. Rev., **B39**, 9580 (1989).
- 36) D. E. Weibel, A. Hoshino, T. Hirayama, M. Sakurai and I. Arakawa: in *Desorption Induced by Electronic Transitions*(DIET V), (Springer, Berlin, 1992) to be published.
- 37) M. Sakurai, T. Hirayama and I. Arakawa: Vacuum, 41, 217(1990).
- 38) A. Hoshino, T. Hirayama and I. Arakawa: J. Vac. Soc. Jpn., 35, 168 (1992).
- 39) K. Stephan, H. Helm and T. D. Märk: J. Chem. Phys., 73, 3763 (1980).

言いわーど

電子遷移誘起脱離(DIET)

固体の表面層に光子や電子を照射したとき、電子励 起を媒介として、その緩和過程の結果として表面から イオンや中性粒子が放出される現象を総称して、電子 遷移誘起脱離(Desorption Induced by Electronic Transitions; DIET)と呼んでいる。励起源の違いにより 電子衝撃脱離(Electron Stimulated Desorption; ESD)、及 び光刺激脱離あるいは光脱離(Photon Stimulated Desorption; PSD)と呼び分けることも多い。

1964年のDIETのモデルを初めて唱えたD. Menzel,

R. Gomer, P. A. Redhead の名からもわかるように,当 初は真空技術の基礎的問題(電離真空計動作時のガス 放出機構)として捉えられていたが,表面物理の実験 手法や放射光技術が発達するに伴い,電子励起による 表面上の反応過程の理解を目的とする物理学上の研究 課題に進展した。

多くの DIET 過程は、表面に局在した励起状態が直接 脱離に結び付くが、希ガス固体のように、固体内部に 生成された励起状態が表面へ拡散し、表面でのエネル ギー緩和により脱離が引き起こされる場合もある。